

真空プラズマクリーナー CUTE・COVANCE・COGRADE



LF真空プラズマ装置は、材料研究分野において基板上有機物除去や表面修飾などの用途に最適なプラズマクリーナーです。

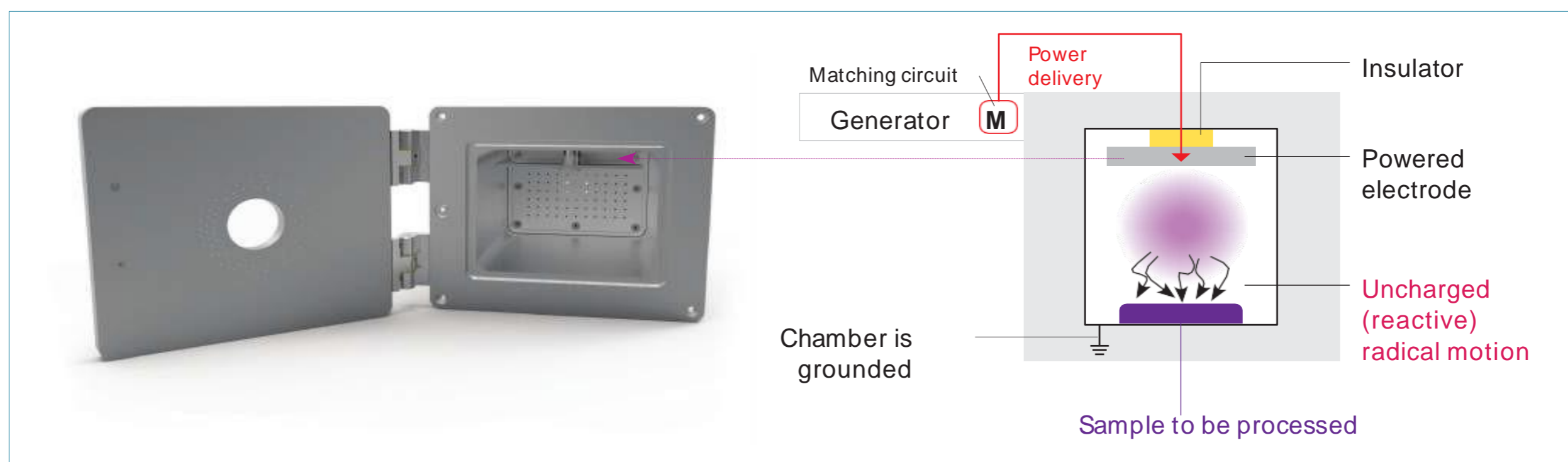
LFプラズマからRFプラズマまでラインナップし、幅広い研究用途にご使用できます。

- アルミ削り出しチャンバーで高い耐久性。
- 独自のガスフローデザインで均一な処理ができます。
- すべての制御がデジタルで、高い再現性が保たれます。
- 最大10レシピを保存できます。
- 周波数・出力・プラズマモードのカスタマイズも可能。

Specification

機種名	CUTE	COVANCE	COGRADE
チャンバー	W140×D200×H110mm	W200×D220×H160mm	W250×D300×H200mm
プラズマモード	PE	PE	PE
周波数/出力	20~100kHz/MAX100W	13.56MHz/MAX200W	13.56MHz/MAX300W
MFC	Max. 100sccm	Max. 200sccm	Max. 500sccm
ガス導入口	1 (マスフローコントローラ) * オプションで2個追加可能	1 (マスフローコントローラ) * オプションで3個追加可能	
装置寸法	W440×D500×H560mm	W510×D525×H640mm	W600×D615×H680mm

PE Mode



Sample is loaded on electrically grounded surface (connected to chamber wall)

1) ナノバイオサイエンス分野

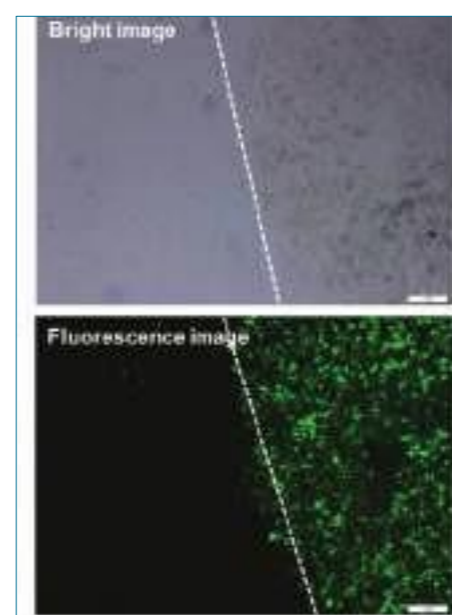
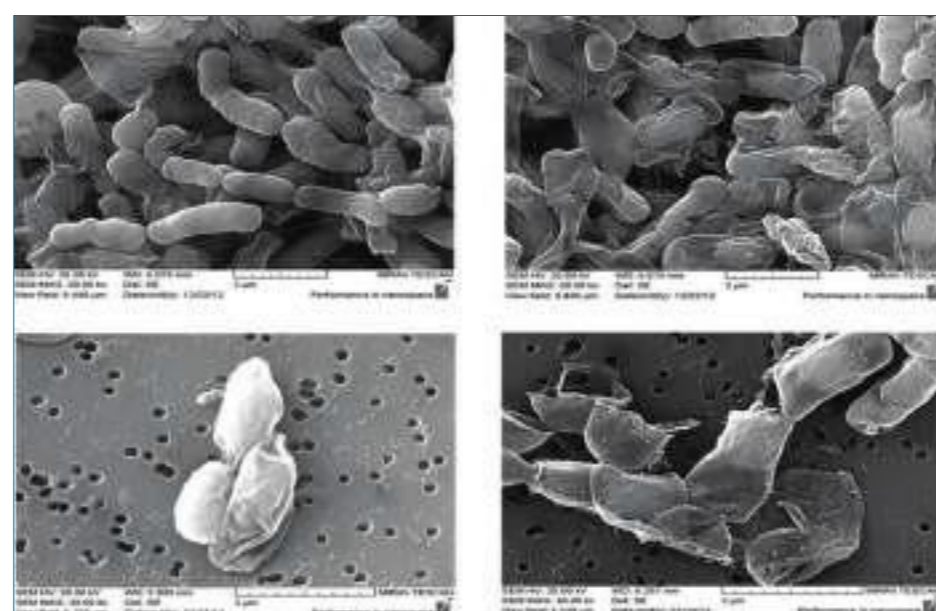
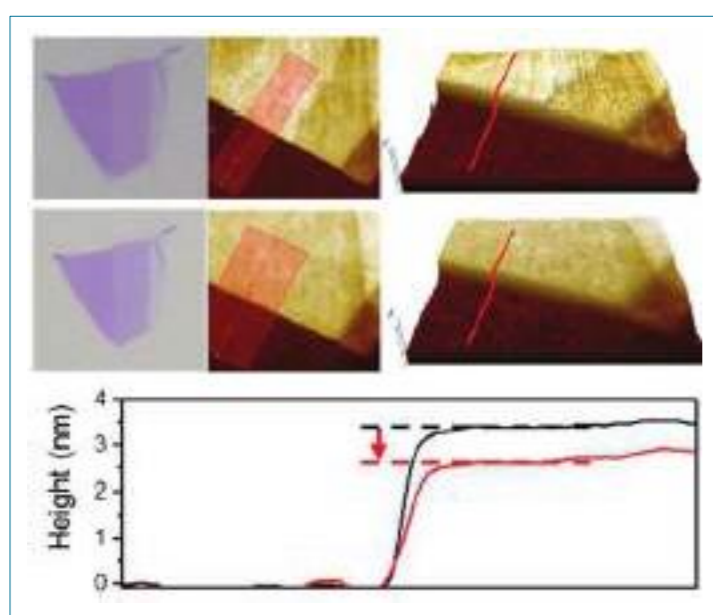
ラボ オン チップ リサーチ
 アミノ基 プラズマ接合
 グルコースセンサー, プロテインチップ

PDMS接合, ガラス表面のクリーニング
 プラスチックの表面処理: 親水性 / 疎水性
 マイクロプラズマ, 酵素調整の前処理など

2) MEMS, 自動車産業, マイクロエレクトロニクス分野, 他

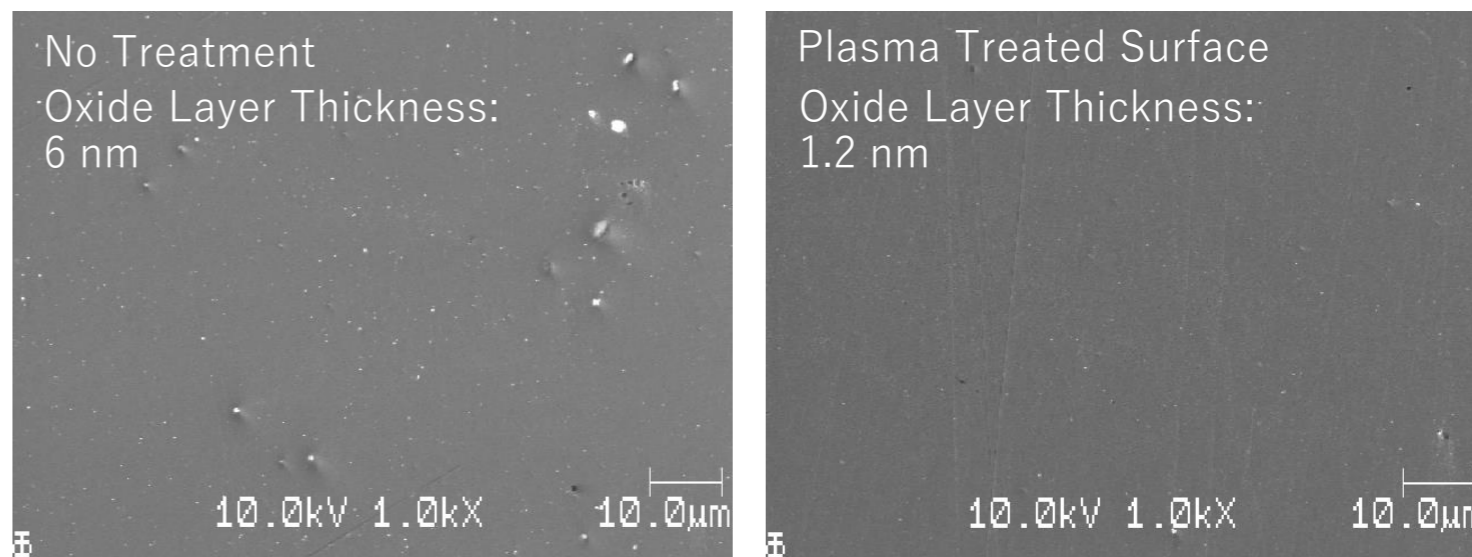
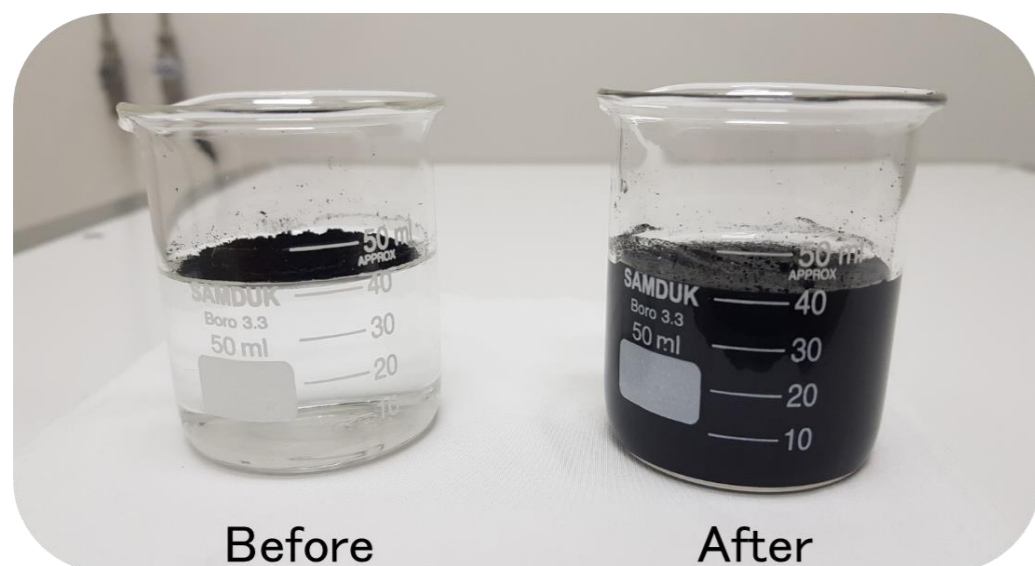
MEMS 研究分野
 プラスチック研究分野
 自動車産業分野
 医学・歯学分野

有機不純物の除去・ナノエッチング
 コーティング前の表面活性化
 シリコンボンディングの活性促進
 チタン表面の親水化



Hydrophobic

Cleaning



上位機種

- COWINシリーズ: チャンバー250 リットルまで対応可。量産等に適したプラズマクリーナー
- VITAシリーズ: RIE(反応性イオンエッチング) 高密度プラズマエッチングアッシングやエッチング用途に

※上位機種に関しては、全てお客様の希望にそったオーダーメイドとなります。

FEMTO SCIENCE 国内総代理店

株式会社 新興精機

大阪営業所 〒564-0052 吹田市広芝町4-1江坂ミナビル403

TEL: 06-6389-6220 FAX:06-6389-6221

● 本社 / 〒812-0054 福岡市東区馬出6丁目14番17号

TEL: 092-624-8010 FAX:092-624-8024

● 営業所 / 北九州・佐賀・熊本・宮崎・鹿児島・東京・名古屋

● カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。 ● カタログの写真や色は印刷により異なる場合があります。

● 本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んだ上でご利用ください。 ● このカタログの制作は2024年8月です。